# 금도금 방법으로 제작한 코일을 이용한 초소형 발전기의 저주파 진동 특성분석

이동호, 김성일\*, 이윤표, 백창욱

# Characterization of a Micro Power Generator using a Fabricated Electroplated Coil Measured at Low Frequency

Dong Ho Lee, Seong-II Kim, Yoon Pyo Lee, Chang-Wook Baek

**Abstract** We have designed and fabricated coil structures by gold electroplating technique. The thickness, width, and length are 7  $\mu$ m, 20  $\mu$ m, and 1.6 m, respectively. With vibrating a magnet on the surface of a fabricated electroplated coil, the micro power generator produce an alternating voltage. We have changed the vibrational frequency from 0.5 Hz to 8 Hz. The generated voltage was 106 mV at 3 Hz and 198 mV at 6 Hz. We have rectified and stepped up the input voltage using a quadrupler circuit. After using the step up circuit, the measured voltage was 81 mV at 3 Hz and 235 mV at 6 Hz.

Key words Electroplating(전기도금), Micro power generator(초소형 발전기), Vibration(진동), Magnet(자석), Coil(코일), Rectifying circuit(정류회로)

\* 한국과학기술연구원 시스템 연구부 ■E-mail : s-ikim@kist.re.kr ■Tel : (02)958-5737 ■Fax : (02)958-5739

## Nomenclature

2

Hz : hertz mV : milli voltage

## subscripts

MPG : micro power generator MEMS : micro electro mechanical system RPM : revolution per minute AC : alternating current DC : direct current

# ]. 서론

반도체 공정 기술이 발전됨에 따라 센서 및 휴대용 전자제품 의 크기가 작아지고, 소비전력도 현저하게 감소하는 추세이다. 일반적으로 대부분의 휴대용 전자제품은 에너지원으로 전지를 사용한다. 그러나 최근에는 RFID(Radio Frequency IDentification)<sup>(1)</sup> 소자나 무선통신소자 (wireless communication device) 등의 발전으로 전지를 사용하지 않는 자가발전소자의 개발을 위한 연구들이 많이 진행되고 있다. 즉 자석과 코일을 이용한 자가발전 소자나 광전효과를 이용한 태 양전지 또는 압전소자<sup>2-3</sup> 등을 이용하는 연구가 활발하게 진행 중에 있다. 이 기술 중에서 자석과 코일을 이용한 발전기의 형 태는 우리가 사용하는 여러 가지 전력원 중 가장 많은 부분을 차지하고 있다. 크게는 대형 수력발전기부터 작게는 자전거에 사용하는 소형 자가발전기 까지 그 종류도 다양하다. 그러나 센서나 전자소자를 동작시키기 위해서는 특정 값 이상의 전압 이 필요하게 되고, 따라서 발생된 전압을 승압시키는 회로가 필요하다. 이 경우 전류 값이 매우 작아지게 되므로 충분한 전 하가 충전될 때까지 커패시터에 전하를 충전하는 것이 필요하 다. 이 방법은 마이크로 센서로부터 데이터를 주고받을 때 적 당한 방법이 될 수 있다. 일반적으로 발생된 전기는 커패시터 나 2차전지에 충전되고 특정의 필요한 값으로 충전되면 회로로 부터 센서로 동작에 필요한 전력이 공급된다<sup>(4)</sup>.

# 2. 개념

본 연구에서는 사각형의 spiral형태로 감격진 고정된 코일 위에서 외부의 진동에너지에 의해 자석이 수평으로 움직일 때 코일의 내부에서 기전력이 발생하는 현상을 이용한다. 기전력은 패러데이 법칙에 의해 발생한 유도기전력이며, 코일의 감긴 횟수와 자속의 시간적 변화율, 즉 왕복진동수에 비례한다. 자석이 외부 진동에 의해 직선 왕복운동을 하게 되면 전자기 유도현상에 의해 교류전압 V를 얻게 된다. 이 발전기에서 발생하는 전류는 교류이기 때문에 센서나 전자소자 등을 구동하기 위해서는 직류로 정류해 줄 필요가 있다. 또한 마이크로 자가발전기의 크기가 작아지게 되면 전압 값 또한 작아지게 되므로 필요에 따라 적당한 값으로 전압을 승압시키는 단계도 필요하다.

## 3. 실험

전기금도금 방법으로 MEMS 코일을 제작하고, 일정하고 균 일한 전압측정을 위하여 진동발생장치를 제작하고 이를 이용 하여 교류 전압 값을 측정하고 채배회로를 설치하여 직류 전압 값을 측정하는 실험을 하였다.

#### 3.1 금도금에 의한 MEMS 코일의 제작

Fig. 1에 금도금 방법으로 코일구조를 제작하기 위한 공정 순서 개요도를 나타내었다<sup>55</sup>. 먼저 Cr/Au 접착층을 증착하고



Fig. 1 금도금 방법으로 코일구조를 제작하기 위한 공정 개요도. (a) 접착층 증착(Cr/Au), (b) 포토레지스트(PR)를 사용한 코일구조 정의, (c) 금도금, (d) 포토레지스트 및 접착층 제거.

(Fig. 2a), 포토레지스트(PR)를 사용한 코일구조 정의한 후 (Fig. 2b), 금도금을 한다(Fig. 2c). 끝으로 포토레지스트 및 접 착층(Cr/Au)을 제거하면 공정이 완료된다. 그 후 개별소자로 절단한 후, 패드에 가는 금선으로 외부 전선과 연결하여 측정 을 하게 된다. Fig. 2 (a)와 (b)는 금도금 방법으로 제작한 MEMS 코일 구조를 주사전자현미경(SEM)으로 관찰한 사진이 고, Fig. 2(a)는 코일의 중심부분을 200배 확대한 사진이고 Fig. 2(b)는 MEMS 코일의 선 부분을 1600배 확대한 사진이 다. SEM 은 FEI 사의 Nova SEM 200 을 사용하였다. 두께는 7 µm, 선폭은 20 µm 이고, 코일의 안쪽에 위치한 패드의 크기는 200 µm x 200 µm 이다. 이때 제작한 MEMS 코일의 저항 값은 1.1 x 200 µm 이다.

#### 3.2 진동측정장치

본 연구에서 주파수에 따른 진동에너지를 측정하기 위해 모 터의 회전 운동을 정확하고 일정하게 수평방향의 진동으로 변 환해주는 진동 발생장치를 제작하였다. Fig. 3은 진동발생장치 의 개요도이다. 크게 세부분으로 회전속도를 조절할 수 있는 속도 조절장치, 회전운동을 하는 모터부와 회전판 마지막으로 회전운동을 직선왕복운동으로 바꿔주는 슬라이더부로 구성되 어 있다. 구체적으로 진동 발생장치는 속도 조절장치와 속도변 환 모터, 선형베어링, 일반베어링 및 아크릴 몸체 등으로 이루



Fig. 2 금도금 방법으로 제작한 MEMS 코일 구조

어져 있다. 선형베어링 위에 슬라이더를 장착하여 자석을 왕복 하여 움직일 수 있게 하였다. 모터의 축에 원형 아크릴 판을 달 았고, 코일의 크기에 따라 자석의 진폭을 조절하기 위하여 원 형 아크릴판 위에 1㎝단위로 베어링을 설치하였다. 아크릴 판 이 회전을 하면 막대의 형태인 아크릴이 슬라이더에 직선 운동 의 형태로 에너지를 전달해준다. AC 속도변환 모터는 최대 600RPM까지 가능하고 이를 직선운동형태로 변환할 경우 진 동수단위로 환산하면 10Hz가 된다.

## 3.3 주파수 변화에 따른 발생전압 특성 분석

금도금으로 제작한 MEMS 코일과 진동발생장치를 이용하 여 교류전압을 발생시켰고 Fig. 4의 채배정류회로를 이용하여 교류전류를 직류로 바꾸고 전압을 채배하는 실험을 하였다. 이 때 전압은 작은 값이므로 다이오드선정에서 순방향 문턱 전압 이 작은 쇼트키다이오드를 사용하는 것이 바람직하다. 이 실험 에서 사용한 커패시터의 용량은 47 JuF 이였다. 위의 실험방법과 같이 진동발생장치를 이용하여 0.5 Hz에서 8Hz까지의 진동을



Fig. 3 진동발생장치의 개요도

만들어서 코일로부터 교류전압을 발생시켰고, 채배정류회로를 사용하여 직류전압을 얻었다. Fig. 5와 Fig. 6은 진동수 3Hz와 6Hz로부터 발생한 교류전압에서 채배정류된 직류전압을 측정 한 그림이다. Fig. 5와 Fig. 7을 비교하면 3Hz의 진동에서 채배 정류회로를 통과한 직류전압 81mV로 채배 되기 전의 교류전압 106mV 보다 25mV낮고, Fig. 6과 Fig. 8을 비교해 보면 6Hz의 진 동에서 채배정류회로를 통과한 직류전압 235 mV로 채배 되기 전의 교류전압 198mV 보다 37mV 높은 것을 알 수 있다. Fig. 9 는 0.5Hz에서 8Hz까지의 진동수에서 0.5Hz단위로 진동에 의한 교류전압과 채배정류된 직류전압을 나타낸 그림이다. 진동수 가 0.5Hz씩 증가하면 교류전압은 거의 일정하게 평균 16mV씩 증가하였지만, 비선형적으로 증가하였다. 결과적으로 채배 되 기 전의 교류전압의 증가율이 일정하게 증가 하였고. 채배정류 된 직류전압은 전압증가율이 점차적으로 증가 하여 약 4.5Hz에 서 전압 값이 같아진다. 4.5Hz 이후에는 채배정류된 전압의 증 가량이 채배정류 되기 전의 증가량보다 10mV 이상 큰 것을 알 수 있다. 따라서 4.5Hz까지는 채배정류회로를 사용하여 얻어진 이득이 채배회로 자체의 저항이나 커패시터와 관련된 손실보 다 작음을 알 수 있었고. 4.5Hz이상부터는 채배회로를 사용한 이득이 손실보다 더 큰 값을 갖고 있음을 알 수 있었다.

# 4. 결 론

전기도금 방법에 의하여 MEMS 코일을 제작하고, 이 코일 위에서 자석을 수평으로 왕복운동 시켜서 초소형발전기의 특 성을 측정하였다. 진동수가 3Hz에서 교류전압106mV 진동수 6Hz에서 교류전압 198mV가 발생하였다. 채배 정류 회로를 이용



Fig. 4 다이오드 4개와 커패시터 4개를 이용한 채배정류회로



Fig. 5 3<sup>1</sup>2에서 발생한 교류전압106™



Fig. 6 6<sup>⊞</sup>에서 발생한 교류전압198₩



Fig. 7 3<sup>H₂</sup>에서 채배정류한 직류전압 81 ₪



Fig. 8 6<sup>1</sup> 에서 채배정류한 직류전압 235 ₪



Fig. 9 채배정류되기전 전압과 채배정류된 전압의 비교

## 논문 2

하여 전압을 채배 시킨 결과 3Hz에서 81mV, 6Hz에서 235mV의 값을 얻었다. 진동수가 증가하면 채배되기 전의 교류전압은 주 파수에 선형적으로 비례하고, 채배 회로를 통한 직류전압은 비 선형적으로 비례한다. 약 4.5Hz근처에서 채배 되기 전 교류전 압과 채배 된 직류전압 값이 같아지고, 4.5Hz 이후에는 채배 정 류된 전압의 증가량이 채배 정류되기 전의 증가량보다 커졌다.

#### References

- I. Byfield, 1996. "Development in RFID", Sensor Review 16, 4, 4-5
- J.H. Ryu, A.V. Carazo, K. Uchino and H.E. Kim, 2001.
  "Magnetroelectric Properties in Piezoelectric and Magnetrostrictive Laminate Composites." Jpn. J. Apll. Phys. 40, 4948-4951

- (3) P. Smalser, 1997. "Power Transfer of Piezoelectric Generated Energy", US patent 5703474, Patent and Trademark Office, Washington, D.C.
- (4) C.B. Williams, R.B. Yates, 1996. "Analysis of a microelectric generator for microsystem." Sensors and Actuators, 52, 8-11
- (5) K. Kawabe, H. Koyama and K. Shirae, 1984. "Planar inductor", IEEE transactions on magnetics, MAG-20, 5

#### 김성일



현재 : 한국과학기술연구원 시스템 연구부 (E-mail : s-ikim@kist.re.kr)

#### 이윤표



현재 : 한국과학기술연구원 시스템 연구부 (E-mail : yplee@kist.re.kr)

#### 이동호



현재 : 국민대학교 물리학과 한국과학기술연구원 시스템 연구부 (E-mail : dhlee7902@kist.re.kr)

#### 백 창 욱



현재 : 중앙대학교 전자전기공학부 (E-mail :cwbaek@cau.ac.kr)